



特殊電極株式会社

超低摩擦係数の厚膜処理技術を開発しました。

当社は、摩擦係数の低い膜が得られる新しい表面処理法（当社名称で**ビスカス法**）を開発しました。

このビスカス法による表面処理膜は、無潤滑下で最適と評価されているDLC（ダイヤモンド・ライク・カーボン）に匹敵する摩擦係数を有するとともに、DLCより厚い皮膜が得られるという特徴を有し、DLCに比べ、摩耗、焼きつきなど作業時のトラブルの減少および製品歩留、製品精度が著しく改善され、併せて**部品寿命が大幅に伸びるとともに、相手部材を摩耗させない利点がある**ことが試販されたプレス金型で実証されました。

平成21年5月22日にプロジェクトチームを編成し、ビスカス法を用いた金型および金型部品の製作・受注活動を開始します。

ビスカス膜と各皮膜の比較

項目	ビスカス膜	DLC 薄膜	TiN 薄膜	クロムメッキ
摩擦係数	0.1~0.16	0.1~0.2	0.4~0.5	0.6~0.8
膜厚 μm	5~100	≒1	1~3	40~50

※ 上記技術に関するお問い合わせは、当社尼崎研究所 村上（06-6482-6472）へご連絡ください。

2009. 5. 21 リリース